

您现在的位置: 首页>新闻中心>科研动态

微系统所院科研装备研制项目“高功率微波在片测试系统”顺利通过验收

2009年02月26日 浏览次数

2月24日,由微系统所孙晓玮研究员承担的2006年度院科研装备研制项目“高功率微波在片测试系统”正式验收。验收会由院计划财务局田东生主持,微系统所科技处处长胡善荣出席会议。

测试专家组通过对设备技术指标的现场测试及实验记录核实,一致认为“高功率微波在片测试系统”各项测试技术指标均满足合同要求。验收专家组听取了项目组的工作总结报告和测试组的测试报告,审查了项目组提供的技术报告等有关资料,进行了充分提问和热烈讨论,并现场核实设备的就位和运行状态,认为“高功率微波在片测试系统”基于脉冲直流馈电偏置方法,结合负载牵引阻抗调配技术,实现了微波功率芯片最佳匹配条件下的最大输出功率的在片测试功能;测量采用软件同步,完成了测试软件平台建立,通过在片自动微波功率芯片的测试系统中应用,证明该平台运行可靠、测量算法正确、系统校准方法可信。仪器运行正常、达到预定技术指标、技术档案齐全、经费使用合理,专家组一致同意通过项目验收。

“高功率微波在片测试系统”项目是微系统所承担的院里第二项仪器研制项目,该项目在仪器的功能集成创新、系统智能化自动控制等方面取得创新性研究成果,项目在执行过程中,申请中国发明专利1项和获得集成电路布图设计登记3项,发表SCI等收录的学术论文6篇,培养了研究生2名。该项目的顺利验收标志着微系统所的仪器研制水平又上了一个新台阶。

test